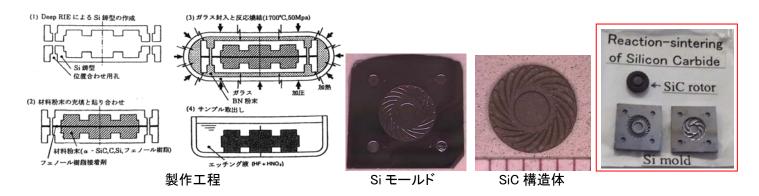
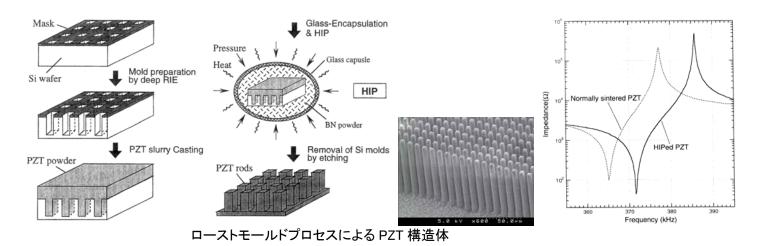
ロストモールドプロセスによる SiC と PZT, 反応焼結による Si₃N₄

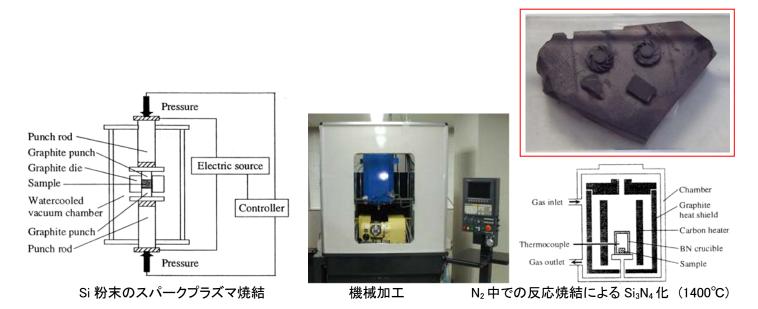


ローストモールドプロセスによる SiC 構造体

参考文献:S.Tanaka, S.Sugimoto, J.F.Li, R.Watanabe and M.Esashi, Silicon Carbide Micro-Reaction
-Sintering Using Micromachined Silicon Molds, J. of Microelectromechanical Systems, 10 (2001) pp.55-61



参考文献: J.-F.Li, S.Wang, K.Wakabayashi, M.Esashi and R.Watanabe, Properties of Modified Lead Zirconate Titanate Ceramics Prepared at Low Temperature (800°C) by Hot Isostatic Pressing, J.American Ceramic Soc., 83 (2000) pp.955-957



Si 粉末のスパークプラズマ焼結後、機械加工および N2 中での反応焼結による Si3N4 構造体

参考文献: S.Sugimoto, S.Tanaka, J.-F.Li, T.Yamada, R.Watanabe and M.Esashi, Three-Dimensional Micromachining of Silicon Nitride for Power Microelectromechanical Systems, Technical Digest of the Transducers' 01 (2001) pp.1140-1143